# Инжекционный фотодиод на основе гетероструктуры *n*-CdS/*p*-CdTe

© Ш.А. Мирсагатов<sup>¶</sup>, Р.Р. Кабулов, М.А. Махмудов

Физико-технический Институт, Научно-производственное объединение "Физика–Солнце" Академии наук Республики Узбекистан, 100084 Ташкент, Узбекистан

(Получена 1 августа 2012 г. Принята к печати 19 сентября 2012 г.)

Показана возможность создания инжекционных фотодиодов с перестраиваемым спектром фоточувствительности в спектральном диапазоне 500–800 nm на основе *n*-CdS/*p*-CdTe-гетероструктуры. Установлено, что такая структура в коротковолновой области спектра,  $\lambda = 500$  нм, имеет самую высокую спектральную чувствительность  $S_{\lambda} \approx 3$  A/BT в прямом направлении при напряжении смещения V = +120 мB и  $S_{\lambda} \approx 2$  A/BT в обратном направлении при напряжении смещения V = -120 мB. Интегральная чувствительность прибора  $S_{int} = 2400$  A/люмен при освещении белым светом  $E = 4 \cdot 10^{-2}$  лк, напряжении смещения V = +4.6 В и температуре T = 293 К. При освещении же монохроматическим светом от лазера ЛГ-75 длиной волны  $\lambda = 625$  nm  $S_{int} = -1400$  A/BT (мощность освещения  $P = 18 \cdot 10^{-6}$  BT/см<sup>2</sup>, напряжение смещения V = +4.6 В и температура T = 293 К). Высокие значения  $S_{\lambda}$  и  $S_{int}$  обеспечивают высокую эффективность превращения световой энергии в электрическую при малых уровнях освещенности ( $P < 18 \cdot 10^{-6}$  BT/см<sup>2</sup>).

### 1. Введение

Гетероструктура n-CdS/p-CdTe является одной из перспективных структур для изготовления дешевого, тонкопленочного и высокоэффективного солнечного элемента (СЭ) для наземного применения [1]. Максимальное значение фототока на СЭ из СdTe при стандартном спектре AM1 (нормированным на 100 мВт/см<sup>2</sup> солнечного излучения) составляет 30.5 мА/см<sup>2</sup>, а теоретически его кпд (*η*) составляет более 29% [1]. Исследовательская группа NREL сообщила о рекордном значении  $\eta = 16.5\%$  СЭ из СdTe, имевшего величину тока короткого замыкания 25.7 мА/см<sup>2</sup> и напряжение холостого хода 850 мВ [2]. Несмотря на хорошую воспроизводимость и высокое значение кпд, дальнейшее улучшение фотовольтаических характеристик тонкопленочных солнечных элементов на основе гетероперехода CdTe/CdS ограничивается многими нерешенными вопросами, связанными с качеством гетерограницы n-CdS/p-CdTe и созданием омического контакта к тыльной поверхности солнечного элемента. Проблема контакта тыльной поверхности солнечного элемента в какой-то мере решена благодаря использованию таких материалов, как Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> или As<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> [3-5]. Эти полупроводники позволяют получать омические контакты и очень низкое контактное сопротивление в сочетании с CdTe *p*-типа.

На границе гетероструктуры *n*-CdS/*p*-CdTe в результате взаимной диффузии S в CdTe и Te в CdS образуется переходная область, состоящая из твердого раствора (TP) CdS<sub>x</sub>Te<sub>1-x</sub> [6,7]. Твердый раствор CdS<sub>x</sub>Te<sub>1-x</sub> является высокоомным, а толщина этого слоя  $\sim 2$  мкм [8], и он в основном определяет электронные процессы в структуре в целом, в том числе и механизм переноса тока [9].

Данная работа посвящена использованию свойства промежуточного слоя гетероструктуры *n*-CdS/*p*-CdTe

для создания инжекционных фотоприемников с перестраиваемым спектром фоточувствительности. Инжекционные фотодиоды — новый класс фотоприемников с внутренним усилением — созданы и исследованы для многих полупроводников (легированные германий и кремний, арсенид галлия, антимонид индия, твердые растворы соединений  $A^{III}B^V$ ,  $A^{II}B^{VI}$  и другие материалы) [10–12]. В литературе не имеется сведений о создании и исследовании инжекционных фотоприемников на основе гетероструктуры *n*-CdS/*p*-CdTe, работающих при комнатной температуре. Данные исследования могут быть полезными в свете создания СЭ на основе гетероструктур *n*-CdS/*p*-CdTe.

### 2. Методика эксперимента

Инжекционный фотодиод представляет собой диод с длинной базовой областью из высокоомного полупроводника [12]. Длина базы в несколько раз превышает длину диффузионного смещения неосновных носителей тока, при этом p-n-переход включается в пропускном направлении. Инжекционный фотодиод работает в режиме высоких уровней инжекции. При этом проводимость базовой области определяется инжектированными носителями. Ранее были исследованы механизмы тока в n-CdS/p-CdTe гетероструктурах с толстым и протяженным слоем промежуточного твердого раствора. Для этих структур соблюдается соотношение  $W/L \approx 3-5$  и  $W/L \approx 10$  (W — длина базы, L — диффузионная длина неосновных носителей) [13,14].

Для проведения представленных исследований были изготовлены 20 In-*n*-CdS/*p*-CdTe-Mo гетероструктур по технологии, описанной в работе [7]. Все структуры показали идентичные характеристики. Базовым материалом для структур служили пленки *p*-CdTe, выращенные методом сублимации в потоке водорода на поверхности подложки. Подложка из молибдена (Mo) также служила

<sup>¶</sup> E-mail: mirsagatov@rambler.ru; krr1982@bk.ru

тыльным собирающим контактом. Удельное сопротивление *p*-CdTe пленок составляло  $\rho \approx 10^3 - 10^4 \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{cm}$ , а ее толщина равнялась  $d \approx 70$  мкм. Эти пленки состоят из блоков микрокристаллов со столбчатой структурой зерен, ориентированных по направлению роста и разориентированных по азимуту. Размеры зерен находятся в пределах от 150 до 250 мкм, так что зерна охватывают всю толщину пленки. Пленка сульфида кадмия *n*-типа проводимости наносилась на поверхность пленки p-CdTe вакуумным испарением толщиной  $d \approx 2-3$  мкм. Верхний "П"-образный собирающий электрод формировался методом термического испарения в вакууме 10<sup>-5</sup> Торр на поверхности пленки CdS. Эффективная площадь входного окна n-CdS/p-CdTe-гетероструктуры, через которую осуществлялось освещение, составляла 4 мм<sup>2</sup>. Световые и темновые вольт-амперные характеристики (ВАХ) структур n-CdS/p-CdTe измерялись при комнатной температуре в прямом и обратном направлениях в широких пределах изменения тока и напряжения. Прямым направлением тока в структуре считалось то, когда к Мо-контакту подавалось положительное напряжение смещения, а обратным — когда было приложено отрицательное напряжение смещения. Освещение производилось в широких пределах освещенности белым светом от лампы накаливания (E = 0.04 - 1.15 лк) и при освещении монохроматическим светом от лазера ЛГ-75 с длиной волны 625 нм ( $P = 18 \cdot 10^{-6} - 3260 \cdot 10^{-6} \text{ BT/cm}^2$ ). Спектральная зависимость фоточувствительности гетероструктур исследовалась монохроматором ЗМР-3 при комнатной температуре. Источником освещения служила лампа накаливания.

### 3. Результаты исследования и их обсуждение

Изготовленные гетероструктуры n-CdS/p-CdTe имели выпрямляющее свойство. Коэффициент выпрямления, определяемый как отношение прямого и обратного тока при постоянном напряжении ( $V = 4 \, \text{B}$ ), составлял более 3 порядков. Темновые вольт-амперные характеристики гетероструктуры n-CdS/p-CdTe, построенные в двойном логарифмическом масштабе, как в прямом, так и в обратном направлениях описываются степенными зависимостями типа  $I \propto V^{\alpha}$  (рис. 1). Результаты показывают, что ВАХ можно разделить на 5 участков с различными значениями  $\alpha$  [13,14]:  $\alpha_1 = 1$  (омического),  $\alpha_2 = 2$  (квадратичного),  $\alpha_3 = 5$ ,  $\alpha_4 = 2$  (квадратичного) и  $\alpha_5 = 3.5$ . Используя метод анализа, проведенный в работах [13,14], из омического и квадратичного участков ВАХ были определены параметры переходной области твердого раствора  $CdS_xTe_{1-x}$ : произведение подвижности на время жизни для дырок  $\mu_p \tau_p = 3.2 \cdot 10^{-7} \, \mathrm{cm}^2 / \mathrm{B}$ и произведение подвижности на концентрацию электронов  $\mu_n n = 1.04 \cdot 10^{10} \, 1/(c \cdot B \cdot cm)$ . Согласно данным [13], при значениях  $\mu_p \tau_p = 3.2 \cdot 10^{-7} \, \text{см}^2/\text{B}$  рекомбинационные процессы протекают через простые локальные



**Рис. 1.** Прямая ветвь темновой вольт-амперной характеристики *n*-CdS/*p*-CdTe гетероструктуры в двойном логарифмическом масштабе. Зависимости *I* от  $V^{\alpha}$  с различными наклонами: *I* —  $\alpha = 1, 2 - 2, 3 - 5.4, 4 - 2, 5 - 3.5.$ 

центры. В работах [13,14] проведен подробный анализ возникновения степенных участков ВАХ с  $\alpha > 2$ . Возникновение таких участков связано с многослойностью твердого раствора  $CdS_xTe_{1-x}$ , где каждый слой имеет определенный состав, различающийся по ширине запрещенной зоны, уровню легирования и толщине. Скорость рекомбинации неравновесных носителей в таких твердых растворах при высоких уровнях возбуждения определяется не только простыми локальными центрами, но и дефект-примесными комплексами. Появление второго квадратичного участка на ВАХ, согласно теории [15], определяется выходом скорости рекомбинации  $U = N_r/\tau_i$  на полное насыщение.

# 3.1. Спектральная зависимость фоточувствительности структуры *n*-CdS/*p*-CdTe

На рис. 2 показана спектральная зависимость фоточувствительности гетероструктуры n-CdS/p-CdTe при подаче напряжения смещения различной величины и полярности. Кривая 1 — без смещения, 2 - V = +40 мB, 3 - V = +80 мB, 4 - V = +120 мB (прямые смещения), 5 — V = -40 мB, 6 — V = -80 мB и 7 — V = -120 мB (обратные смещения). Из рис. 2 видно, что кривые фоточувствительности в прямом направлении напряжения смещения дважды пересекают ось абсцисс. При этом инверсия знака фотоэдс происходит в коротковолновой U<sub>f1</sub> (U<sub>f1</sub> — точка инверсии фотоэдс в коротковолновой части спектра) и длинноволновой U<sub>f2</sub> областях спектра (Uf2 — точка инверсии фотоэдс в длинноволновой части спектра). Например, при подаче напряжения смещения  $U_{\text{bias}} = +40 \text{ мB}$  инверсия знака фотоэдс происходит при  $\lambda = 560.6$  нм в коротковолновой области спектра, а в длинноволновом диапазоне при  $\lambda = 808.2$  нм. Точка знака инверсии фотоэдс  $(U_{f1})$ ,



**Рис. 2.** Спектральные зависимости фоточувствительности *n*-CdS/*p*-CdTe гетероструктуры при различных значениях приложенного напряжения смещения  $U_{\text{bias}}$ , мВ: 1 - 0, 2 - (+40), 3 - (+80), 4 - (+120), 5 - (-40), 6 - (-80) и 7 - (-120).

наблюдаемая в коротковолновой части спектра, с ростом величины напряжения смещения сдвигается в длинноволновую часть спектра. Вторая точка инверсии  $(U_{f2})$ , наоборот, сдвигается в сторону коротковолновой части спектра. Следует отметить, что скорость сдвига точек инверсии  $(U_{f1})$  и  $(U_{f2})$  в зависимости от приложенного напряжения по оси " $\lambda$ " является разной. Например,  $U_{f1}$ при изменении напряжения смещения от 10 до 120 мВ сдвигается в сторону длинных волн на 121 нм, а  $U_{f2}$ на 16 нм в сторону коротких длин волн. При этом эффективная разрешающая способность для точки U<sub>f1</sub> составляет  $\sim 1.37$  нм/мВ, а у  $U_{f2} - \sim 0.15$  нм/мВ. На кривой распределения фототока также ясно можно видеть, что с ростом величины напряжения смещения изменяется полярность и эффективное значение фототока. Интегральный ток состоит из фототока и инжекционного тока, которые направлены в противоположных направлениях. Поэтому динамика изменения фототока с длиной волны оптического излучения и увеличение инжекционного тока с ростом напряжения смещения сложным образом накладываются друг на друга. Этот эффект заметно проявляется в коротковолновой области и в области максимальной фоточувствительности структуры. В коротковолновой части спектрального распределения ток с малых значений напряжения смещения меняет свой знак и его величина возрастает с увеличением V. Чем больше значение напряжения смещения, тем в большей части коротковолнового диапазона ток изменяет свой знак, т.е. свое направление. Значение фототока в области максимума спектрального распределения стремительно уменьшается. Анализ динамики изменения кривой спектрального распределения фоточувствительности в зависимости от приложенного напряжения показывает, что в данной структуре происходит усиление первичного фототока в пропускном направлении с

ростом напряжения. В качестве доказательства этого была измерена спектральная фоточувствительность на максимуме ( $\lambda = 750$  нм, см. рис. 2) кривой спектральной чувствительности при V = 0. При этом измерение показывает, что при мощности падающего излучения  $P = 1.02 \cdot 10^{-5}$  Вт/см<sup>2</sup> из монохроматора 3МР-3 ток короткого замыкания равен  $I_{sc} = 2.94 \cdot 10^{-8}$  А, а напряжение холостого хода  $U_{oc} = 36$  мВ. Освещаемая площадь составляла  $S \approx 0.2$  мм<sup>2</sup>. Далее, используя мощность падающего излучения и  $I_{sc} = 2.94 \cdot 10^{-8}$  А определяем, что спектральная чувствительность имеет величину  $S_{\lambda} = 1.44$  А/Вт. В то же время спектральная чувствительность для идеального фотоприемника, определенная по формуле (1) в работе [16], составляет величину 0.604 А/Вт при условиях, что  $\eta_{\lambda} = 1, R_{\lambda} = 0$ :

$$S_{\lambda} = \frac{q}{hc} \,\lambda \eta_{\lambda} (1 - R_{\lambda}), \qquad (1)$$

где q — модуль заряда электрона,  $\lambda$  — длина волны излучения,  $\eta_{\lambda}$  — внутренний квантовый выход и  $R_{\lambda}$ коэффициент отражения при данной величине длины волны оптического излучения. Под идеальным фотоприемником [16] понимается такой фотоприемник, у которого в формировании фототока участвуют все падающие фотоны на поверхность фотоприемника. Обычно такие фотоприемники отсутствуют, поскольку они идеализированы. Поэтому можно полагать, что гетероструктура n-CdS/p-CdTe имеет большую спектральную чувствительность в результате внутреннего усиления фототока, т.е. за счет перераспределения потенциала между n-CdS (твердый раствор) и базой — ТР CdS<sub>x</sub>Te<sub>1-x</sub> из-за модуляции сопротивления базы структуры при освещении. Из рис. 2 следует, что самое высокое усиление фототока, равное 3 А/Вт, наблюдается в коротковолновой части спектра фоточувствительности, и оно обусловлено вкладом сопротивления состава ТР, примыкающего к слою *n*-CdS, в общее сопротивление структуры.

При обратном напряжении смещения спектральная чувствительность  $S_{\lambda}$  при  $\lambda = 500$  нм начинает возрастать и, достигнув максимума спектральной чувствительности при  $\lambda = 650$  нм, начинает плавно уменьшается с дальнейшим возрастанием длины волны излучения. Вблизи края поглощения, в длинноволновой части спектра  $(\lambda \approx 800 \,\mathrm{нm})$ , наблюдается резкое уменьшение фоточувствительности. При этом с увеличением обратного напряжения смещения спектральная чувствительность во всем диапазоне спектральной чувствительности возрастает, что свидетельствует о совпадении направлений фототока и инжекционных токов. Однако величины  $S_{\lambda}$  в прямом и обратном направлениях смещения отличаются при одном и том же значении напряжения смещения. Значение спектральной чувствительности в обратном направлении смещения обычно меньше, чем в прямом направлении тока. Разница их определяется свойствами фронтального и тылового барьеров, а также свойствами слоев твердых растворов, где поглощаются фотоны и генерируются электронно-дырочные пары, и каким барьером они разделяются. Другими словами, разница спектральной чувствительности структуры объясняется инжекционными свойствами барьеров между твердым раствором CdS и твердым раствором MoO<sub>3</sub> (см. рис. 2, кривые 4 и 7). Следует отметить, что составы пленок твердых растворов, контактирующих со слоями CdS и MoO<sub>3</sub>, разные [17].

# 3.2. Вольт-амперная характеристика при освещении лазерным излучением

Вольт-амперные характеристики гетероструктуры *n*-CdS/*p*-CdTe были исследованы при различных уровнях освещенности монохроматическим светом от лазерного источника ЛГ-75 длиной волны  $\lambda = 625 \, {\rm mm}$ при следующих мощностях излучения:  $P = 18 \cdot 10^{-6}$ ,  $40 \cdot 10^{-6}$ ,  $268 \cdot 10^{-6}$  и  $3260 \cdot 10^{-6}$  Вт/см<sup>2</sup>. Было обнаружено, что световые вольт-амперные характеристики гетероструктуры n-CdS/p-CdTe при освещении лазерным излучением по форме не отличаются от темновых, однако они отличаются по величине тока при заданном значении напряжения смещения. В таблице представлены результаты определения показателя степени  $\alpha$ для случая освещения от лазерного источника. В этом случае отсутствуют как линейный участок, так и первый квадратичный участок. Полученные экспериментальные результаты показывают, что при облучении базовая область структуры (TP  $CdS_xTe_{1-x}$ ) изменяет свое сопротивление и переходит на новое качественное состояние, а в рекомбинационных процессах принимают участие сложные комплексы, о чем свидетельствуют крутые участки ВАХ со значением  $\alpha \ge 2$  [13,14].

На рис. З представлена зависимость интегральной чувствительности  $(S_{int})$  от напряжения смещения при различных мощностях лазерного облучения. Вид зависимости  $S_{int}$  от V в прямом и обратном направлениях смещения качественно отличаются не только по

Значение параметра  $\alpha$  в зависимости  $J \propto V^{\alpha}$  на различных участках вольт-амперной характеристики при различных уровнях освещенности

Параметр $\alpha$ в $J \propto V^{\alpha}$ , освещенность	$\alpha_1$	$\alpha_2$	α <sub>3</sub>	$lpha_4$	$\alpha_5$
E = 0	1	2	5.4	1.7	3.5
0.04 лк, белый	_	4.26	6.5	1.72	3.7
0.152 лк, белый	_	_	6.8	2	3.4
0.48 лк, белый	_	_	8	1.73	3
$P = 18 \cdot 10^{-6} \mathrm{Bt/cm^2},$	_	_	6.8	1.2	2.82
$\lambda = 625$ HM $P = 40 \cdot 10^{-6}$ BT/cm <sup>2</sup> , $\lambda = 625$ HM	_	_	6	1.38	3.13
$P = 268 \cdot 10^{-6} \mathrm{Bt/cm^2},$	_	_	8.8	1.53	3
$\lambda = 625 \text{ hm}$ $P = 3260 \cdot 10^{-6} \text{ Bt/cm}^2,$ $\lambda = 625 \text{ hm}$	_	—	8	1.56	3.3



**Рис. 3.** Фоточувствительность гетероструктуры *n*-CdS/*p*-CdTe при различном напряжении смещения и уровне освещения от лазерного излучения длиной волны 625 нм. *P*, BT/cm<sup>2</sup>:  $I = 18 \cdot 10^{-6}$ ,  $2 = 40 \cdot 10^{-6}$ ,  $3 = 268 \cdot 10^{-6}$ ,  $4 = 3260 \cdot 10^{-6}$ .

форме, но и по количественным показателям. В обратном направлении смещения величина S<sub>int</sub> достигает самого высокого значения при низкой энергии облучения ( $P = 18 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{Bt/cm^2}$ ), которое равно 30 А/Вт при V = -4 В. Далее с ростом энергии лазерного облучения величина S<sub>int</sub> уменьшается и становится равной 3 А/Вт при  $P = 3260 \cdot 10^{-6} \,\text{Вм/см}^2$ . В прямом направлении ВАХ зависимость S<sub>int</sub> от напряжения смещения имеет сложный вид. При малой энергии лазерного облучения интегральная чувствительность при V = 0.9 В достигает максимума, после чего, с увеличением напряжения смещения, ток в цепи фотоприемника начинает резко уменьшаться и изменяет свое направление. В результате этого эффекта интегральная чувствительность также изменяет знак и далее с увеличением напряжения смещения стремительно растет по величине и становится равной 1400 А/Вт при V = +4.6 В. Такое поведение интегральной чувствительности обусловлено увеличением инжекционного тока. При этом в зависимости  $S_{int}$  от Vимеются участки подъема и падения, которые, вероятно, связаны с рекомбинационными процессами на границе слоев твердого раствора, образующих между собой изотипные гетеропереходы. Следует отметить, что изменение знака интегральной чувствительности происходит при малых энергиях лазерного облучения ( $P = 18 \cdot 10^{-6}$ и 40 · 10<sup>-6</sup> Вт/см<sup>2</sup>). При больших энергиях лазерного облучения изменения знака тока в цепи фотоприемника не происходит — чем больше энергия лазерного облучения, тем меньше значения S<sub>int</sub> (см. рис. 3, кривые 3 и 4). При больших энергиях лазерного облучения и при больших напряжениях смещения доля разделенных фотоносителей тыловым барьером (гетеропереходом *p*-CdTe-MoO<sub>3</sub>) становится определяющей. В этом случае направления фототока и инжекционного тока в структуре совпадают, что и подтверждается экспериментом. Следовательно, в структуре происходит внутреннее усиление и важнейшим показателем является то, что величина интегральной чувствительности намного больше, чем интегральной чувствительности обычных фотоприемников. Следует отметить, что при энергии лазерного луча  $P = 268 \cdot 10^{-6} \text{ BT/cm}^2$  интегральная чувствительность равна 70 А/Вт при V = 4 В. Это свидетельствует о том, что происходит перераспределение потенциала между фронтальным барьером и базой структуры, в результате этого происходят дополнительная инжекция носителей и внутреннее усиление фототока. При энергии же лазерного облучения  $P = 3260 \cdot 10^{-6} \text{ BT/cm}^2$  величина  $S_{\text{int}}$  равна нескольким единицам А/Вт. Этот факт показывает, что перераспределение потенциалов между барьерами происходит незначительно.

#### 3.3. ВАХ при освещении белым светом

Исследованы ВАХ при освещении белым светом от лампы накаливания при различных уровнях освещенности E: -0.04, 0.15 и 0.48 лк (рис. 4). При этом установлено, что темновые и световые ВАХ гетероструктур n-CdS/p-CdTe по своей форме идентичны и отличаются они только по значениям токов. Анализ световых ВАХ показывает, что они имеют пять степенных участков  $I \propto V^{\alpha}$  с различными величинами  $\alpha$ . В таблице представлены рассчитанные значения  $\alpha$  для различных участков и уровней освещенности. Из этой таблицы видно, что с увеличением освещенности исчезают линейный участок и первый квадратичный участок. На третьем участке значение  $\alpha$  возрастает от 5 до 8. На четвертом участке ВАХ сохраняется квадратичность. На пятом участке величина α уменьшается от 3.5 до 3. Из этих данных следует, что с увеличением уровня освещенности исследуемая структура переходит в новое качественное состояние и рекомбинационные процессы в структуре



**Рис. 4.** Прямые ветви световой вольт-амперной характеристики *n*-CdS/*p*-CdTe гетероструктуры при различных уровнях освещенности белым светом *E*, лк: 1 - 0.04, 2 - 0.15, 3 - 0.49 и 4 - 1.15.



**Рис. 5.** Зависимости фоточувствительности гетероструктуры *n*-CdS/*p*-CdTe от напряжения смещения при различных уровнях освещенности белого света *E*, лк: I = 0.04, 2 = 0.15, 3 = 0.49 и 4 = 1.15.

начинают протекать не только через простые локальные центры, но также и через сложные комплексы, в которые захватываются носители заряда [13,15].

На рис. 5 представлены экспериментальные результаты интегральной чувствительности гетероструктуры n-CdS/p-CdTe от приложенного напряжения и освещенности. При обратном направлении ВАХ, т.е. при подаче отрицательного напряжения смещения на Мо-контакт, происходит усиление фототока, которое уменьшается с увеличением освещенности. Например, при *E* = 0.04 лк интегральная чувствительность  $S_{\text{int}} \approx 350 \text{ А/люмен}$  (или  $S_{\text{int}} \approx 3.85 \cdot 10^4 \text{ A/Bt}$  [18]) при V = -4 В, а при E = 1.15 лк  $S_{int} \approx 1.6$  А/люмен  $(\sim 176 \,\text{A/Bt})$  при  $V = -4 \,\text{B}$ . Из этих данных следует, что, во-первых, направления инжекционного тока и фототока совпадают; во-вторых, при больших уровнях освещенности (*E* ≥ 1.15 лк) практически не происходит перераспределение потенциала между базой структуры и тыловым барьером при освещении. В прямом направлении ВАХ усиление фототока от напряжения смещения происходит сложным образом независимо от уровня освещенности. При освещении белым светом E = 0.04 лк интегральная чувствительность достигает максимальной величины при  $V = 1 \, \text{B}$ ,  $S_{\text{int}} = 400 \text{ А/люмен} \ (\sim 4.4 \cdot 10^4 \text{ А/Вт}),$  после чего величина фототока падает с дальнейшим увеличением напряжения смещения. Затем величина S<sub>int</sub> вновь начинает возрастать с  $V = +4 \,\mathrm{B}$  и при  $V = +4.6 \,\mathrm{B}$  достигает величины  $S_{\rm int} \approx 2400$  А/люмен ( $\sim 2.7 \cdot 10^5$  А/Вт). В зависимости S<sub>int</sub> от напряжения смещения V наблюдается несколько максимумов и минимумов, которые приобретают отчетливый контур при уровнях освещенности *E* = 0.15 и *E* = 0.49 лк. Появление максимумов связано с процессами поглощения фотонов в слоях твердого раствора, а минимумы с процессами поглощения на границе раздела изотипных гетеропереходов, образованных между различными составами ТР  $CdS_{X}Te_{1-x}$ . При этом отметим, что месторасположения всех максимумов и минимумов при всех условиях освещенности находятся в одном месте на оси напряжений.

### 4. Заключение

Создан инжекционный фотодиод с перестраиваемым спектром фоточувствительности на основе гетероструктуры n-CdS/p-CdTe. Исследования световой ВАХ и спектральной характеристики фоточувствительности показали, что структура n-CdS/p-CdTe-Mo как в прямом, так и в обратном направлениях смещения работает как инжекционный фотодиод. Величина спектральной чувствительности такой гетероструктуры в обратной ВАХ при напряжении смещения V = -120 мВ в области длин волн 500-800 нм изменяется от 1.6 до 1.8 А/Вт. Она во много раз превышает спектральную чувствительность идеального фотоприемника  $(S_{\lambda} = 0.4 - 0.64 \text{ A/Bt}$  в этой области спектра излучения). В прямом направлении ВАХ при напряжении смещения V = +120 мВ спектральная чувствительность в области длин волн 500-800 нм изменяется от 3 до 1 А/Вт. При этом наблюдается инверсия знака фотоэдс в длинноволновой и коротковолновой части спектра. Эффективная спектральная разрешающая способность *n*-CdS/*p*-CdTe гетероструктуры в коротковолновой части видимого спектра составляет 1.37 нм/мВ. В длинноволновой части спектра она равна 0.15 нм/мВ. Интегральная чувствительность гетероструктуры n-CdS/p-CdTe  $S_{\rm int} \approx 2400 \, {\rm A}$ /люмен ( $\sim 2.7 \cdot 10^5 \, {\rm A}/{\rm Br}$ ) при комнатной температуре при освещении белым светом  $(E = 4 \cdot 10^{-2} \,\mathrm{лk})$  и напряжении смещения  $V = +4.6 \,\mathrm{B}$ . При освещении монохроматическим светом от лазерного источника ЛГ-75 длиной волны  $\lambda = 625$  нм интегральная чувствительность гетероструктуры n-CdS/p-CdTe  $S_{\rm int} \approx -1400 \, {\rm A/Bt}$  при комнатной температуре, мощности излучения  $P = 18 \cdot 10^{-6} \, \mathrm{Br/cm^2}$  и напряжении смещения V = +4.6 В. По сравнению с аналогами созданный инжекционный фотоприемник имеет повышенные функциональные характеристики и работает при комнатных температурах. Достижение высоких функциональных характеристик фотоприемника объясняется эффектом перераспределения электрического потенциала между барьерами и базой структуры фотоприемника под действием освещения.

### Список литературы

- K. Durose, P.R. Edwards, D.P. Holiday. J. Cryst. Growth, 197, 733 (1999).
- [2] X. Wu, J.C. Keane, R.G. Dhere, C. Dehert, D.S. Albin, A. Dude, T.A. Gessert, S. Asher, D.H. Levi, P. Sheldon. Proc. 17th Eur. Photovoltaic Solar Energy Conference (Munich, Germany, 2001) v. 2, p. 995.

- [3] N. Romeo, A. Bosio, R. Tedeschi, V. Canevari. Thin Sol. Films, 361, 327 (2000).
- [4] D.L. Baetzner, A. Romeo, H. Zogg. Thin Sol. Films, 387, 151 (2001).
- [5] A. Zappettini, F. Bissoli, E. Gombia, A. Bosio, N. Romeo. *Nuclear Science Symposium Conference Record* (IEEE, 2004) v. 7, p. 4518.
- [6] M.K. Herndon, A. Gupta, V.I. Kaydanov, R.T. Collins. J. Appl. Phys. Lett., 75 (22), 3503 (1999).
- [7] Ж. Жанабергенов, Ш.А. Мирсагатов, С.Ж. Каражанов. Неорг. матер., **41**, 915 (2005).
- [8] С.А. Музаффарова, Ш.А. Мирсагатов, Ж. Жанабергенов. ФТТ, 49 (6), 1111 (2007).
- [9] Ш.А. Мирсагатов, А.Ю. Лейдерман, Б.У. Айтбаев, М.А. Махмудов. ФТТ, **51** (10), 1917 (2009).
- [10] Ш.А. Мирсагатов, А.А. Мавлонов, Б.У. Айтбаев. *Матер. II Междунар. конф.* (Фергана, 8–9 сентября 2011).
- [11] В.И. Стафеев. Инжекционные диоды (М., ФГУП НПО "Орион", 2008) с. 103.
- [12] И.М. Викулин, Ш.Д. Курмашев, В.И. Стафеев. ФТП, 42 (1), 113 (2008).
- [13] Ш.А. Мирсагатов, А.Ю. Лейдерман, Б.У. Айтбаев, М.А. Махмудов. ФТТ, **51** (10), 1917 (2009).
- [14] Х.Х. Исмаилов, А.М. Абдугафуров, Ш.А. Мирсагатов, А.Ю. Лейдерман. ФТТ, 50, 11 (2008).
- [15] А.Ю. Лейдерман, М. Минбаева. ФТП, 30, 1729 (1996).
- [16] А. Амброзяк. Конструкция и технология полупроводниковых фотоэлектрических приборов (М., 1970).
- [17] Ш.А. Мирсагатов, А.К. Утениязов, А.С. Ачилов. ФТТ, 54 (9), 1643 (2012).
- [18] Э. Фриш. Оптические методы измерения (Л., Изд-во ЛГУ, 1976) ч. 1.

Редактор Т.А. Полянская

## Injection photodiodes based on *n*-CdS/*p*-CdTe heterostructures

Sh.A. Mirsagatov, R.R. Kabulov, M.A. Maxmudov

Physicotechnical Institute Academy of Science of the Republic of Uzbekistan, 100084 Tashkent, Uzbekistan

**Abstract** Possibilities of the creation of the injection photodiodes based on *n*-CdS/*p*-CdTe heterostructures with reconfigurable spectrum of the photosensitive in spectral range of 500–800 nm are shown. It is installed the structure has highest spectral sensivity at the short wave range ( $\lambda = 500 \text{ nm}$ )  $S_{\lambda} = 3 \text{ A/W}$  at direct voltage V = +120 mV, and  $S_{\lambda} = 2 \text{ A/W}$  at inverse attached voltage V = -120 mV. Integral photosensitivity of the structure is  $S_{\text{int}} = 2400 \text{ A/lumen}$  under the illumination of white light  $E = 4 \cdot 10^{-2} \text{ lx}$ , attached voltage V = +4.6 V (T = 293 K) and at illumination by monochromatic laser light by wavelength 625 nm  $S_{\text{int}} = 2400 \text{ A/W}$  (light power  $P = 18 \cdot 10^{-6} \text{ W/cm}^2$ , attached voltage V = +4.6 V and temperature T = 293 K). The high values of  $S_{\lambda}$  and  $S_{\text{int}}$  provide high efficiency of the conversation light energy in electric energy under small level of radiation ( $P < 18 \cdot 10^{-6} \text{ W/sm}^2$ ).